

Laserinterferometersystem ZLM 500, Carl Zeiss Jena



Erfassung von:

- ► Positionsabweichungen
- ► Längen, Winkel
- ► Geradheit, Ebenheit
- ► Schwingungen
- ► CNC-Steuerungskompensation

Rotatorische Geber, Heidenhain

Erfassung von:

- ► Teilungsabweichungen
- ► Kombinationen aus Längen (Laser) und Winkelmessungen (z.B. Wälzabweichungen)